

# Posudek práce

předložené na Matematicko-fyzikální fakultě  
Univerzity Karlovy v Praze

posudek vedoucího  
 bakalářské práce

posudek oponenta  
 diplomové práce

Autor: Stanislav Haviar

Název práce: Nanomanipulace v SEM

Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika

Rok odevzdání: 2008

Jméno a tituly vedoucího: Prof. RNDr. Vladimír Matolin, DrSc

Pracoviště: KFPP

Kontaktní e-mail: matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz

Odborná úroveň práce:

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující

Věcné chyby:

téměř žádné  vzhledem k rozsahu přiměřený počet  méně podstatné četné  závažné

Výsledky:

originální  původní i převzaté  netriviální komplikace  citované z literatury  opsané

Rozsah práce:

veliký  standardní  dostatečný  nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující

Tiskové chyby:

téměř žádné  vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet  četné

Celková úroveň práce:

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující

**Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:**

Práce byla zaměřena na problematiku, která nebyla doposud na našem pracovišti řešena, a která souvisí s přípravou „jednovodičových“ nanostrukturálních senzorů pro detekci plynů. Tyto senzory budou mít podobu několika mikrometrů dlouhých tyčinek oxidů  $\text{SnO}_2$ ,  $\text{WO}_x$ , a  $\text{CeO}_x\text{-SnO}_x$  o průměru několika desítek nanometrů deponovaných na planárních substrátech. Struktury budou připravovány metodou elektronové litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM) s vysokým rozlišením.

Cílem práce bylo odzkoušet metodu přípravy nano- a mikro- struktur metodou e-litografie, která byla dodána pro nový mikroskop v době zahájení práce. jedná se o složitý proces vyžadující zvládnutí mnoha dílčích úkolů, především práce se SEM ve vysokém rozlišení, správnou volu expozic, vyvolávání rezistů PMMK a lift-off techniku a zvládnutí prototypu programu draw-beam (od fý Tescan).

Příprava prvních struktur Cr s šírkou menší než 100 nm ukázala, že pan Haviar tuto práci velmi dobře zvládl. Vzhledem ke složitosti celé problematiky, kdy ani výrobce nebyl, vzhledem k novosti problematiky, schopen dodat informace pro správný postup, lze konstatovat, že pan Haviar podal vysoko nadprůměrný výkon, který byl na úrovni dostatečné pro řešení diplomové práce.

Pan Haviar projevil velkou dávku samostatnosti a tvořivosti a ukázal, že je schopen řešit náročné experimentální problémy. Jeho práce byla velmi rozsáhlá a některé části, např. týkající se využití nanomanipulátorů v SEM, nebylo možno do bakalářské práce z prostorových důvodů zařadit. Práci proto hodnotím jako výjimečně kvalitní.

**Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:**

**Práci**

- doporučuji  
 nedoporučuji  
uznat jako bakalářskou.

**Navrhoji hodnocení stupněm:**  
 výborně  velmi dobré  dobré  neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:

V Praze 17. 6. 2008

